

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-501116

(P2008-501116A)

(43) 公表日 平成20年1月17日(2008.1.17)

(51) Int. Cl.

GO1B 7/06 (2006.01)

F1

GO1B 7/06

M

テーマコード(参考)

2F063

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全12頁)

(21) 出願番号 特願2007-514978 (P2007-514978)
 (86) (22) 出願日 平成17年5月20日 (2005.5.20)
 (85) 翻訳文提出日 平成18年11月27日 (2006.11.27)
 (86) 国際出願番号 PCT/SE2005/000750
 (87) 国際公開番号 W02005/116576
 (87) 国際公開日 平成17年12月8日 (2005.12.8)
 (31) 優先権主張番号 0401372-8
 (32) 優先日 平成16年5月28日 (2004.5.28)
 (33) 優先権主張国 スウェーデン(SE)

(71) 出願人 503260712
 ダブロックス アクチボラゲット
 スウェーデン国、スカルホルメン、ピー、
 オー、ボックス 120
 (74) 代理人 100066692
 弁理士 浅村 皓
 (74) 代理人 100072040
 弁理士 浅村 肇
 (74) 代理人 100087217
 弁理士 吉田 裕
 (74) 代理人 100072822
 弁理士 森 徹
 (72) 発明者 オーケルプロム、ベングト
 スウェーデン国、ヴォールビィ、ヴォール
 ビィ アレ 23

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 移動するストリップの層厚を測定する装置及び方法

(57) 【要約】

本発明は、移動ストリップ2の少なくとも1層の厚さを測定する装置1と方法とに関するものである。該測定装置1はトランスミッタ本体4を含み、トランスミッタ本体は、トランスミッタ・ハウジング3内を軸方向に可動であり、ガス・クッション2を介してストリップ層に載置される、ハウジング3から突出したセンサヘッド5と、トランスミッタ・ハウジング3内に画成されたチャンバ7内へ延びる上部6とを有している。トランスミッタ・ハウジング3は、ガス供給用の少なくとも1つのポート9を備え、このガスの一部は前記ガス・クッションを形成し、また一部はチャンバ7内へ流入する。この測定装置の特徴は、トランスミッタ・ハウジング3が、チャンバ7からガスを排出するためのリストリクタ10を備えていることである。また、この測定方法は、測定装置1によりストリップ層2を測定する段階を含み、該リストリクタ10は、ストリップ層2に対するガス・クッションの圧力が0-65g/cm2重量等量となるように調節される。

